

1. Сушильна установка стабілізованого високого вакууму для промислових шкур та подібних продуктів, що містить кілька сушильних шарів (2, 2', 2'') з нагрівальними платформами (3, 3', 3'') та герметичними кришками (4, 4', 4''), вакуумний пристрій (7), з'єднаний з сушильними шарами для видалення парів, що надходять від шкур, та для зниження тиску до найнижчого робочого значення (P_i), контур з клапанами (10, 10', 10''; 11, 11', 11'') для селективного підключення зазначених сушильних шарів до зазначеного вакуумного пристрою, яка **відрізняється** тим, що контур з клапанами містить принаймні один відсічний клапан (10, 10', 10'') за кожним сушильним шаром для селективного підключення зазначеного шару, спочатку під атмосферним тиском, до вакуумного пристрою (7), та принаймні один запірний клапан (11, 11', 11'') для автоматичного ізолювання решти шарів, які вже знаходяться під робочим тиском, аби уникнути перепадів тиску всередині установки.
2. Сушильна установка високого вакууму за п. 1, яка **відрізняється** тим, що зазначений вакуумний пристрій (7) містить первинний вакуум-насос (8) для скидання тиску в контурі до завданої величини P_s , яка перевищує мінімальну робочу величину (P_i).
3. Сушильна установка високого вакууму за п. 2, яка **відрізняється** тим, що зазначений вакуумний пристрій (7) містить вторинний вакуум-насос (9), який у взаємодії з зазначеним первинним вакуум-насосом (8) знижує тиск у контурі до зазначеної мінімальної робочої величини (P_i).
4. Сушильна установка високого вакууму за п. 3, яка **відрізняється** тим, що зазначений вторинний вакуум-насос (9) являє собою повітродувку.
5. Сушильна установка високого вакууму за п. 3, яка **відрізняється** тим, що зазначений контур містить байпасний клапан (17) для селективного виведення з контуру зазначеного вторинного насоса (9).
6. Сушильна установка високого вакууму за п. 5, яка **відрізняється** тим, що містить аспіраційний розподільник (12) за зазначеним вакуумним пристроєм для збирання парів, що надходять із зазначених шарів (2, 2', 2'').
7. Сушильна установка високого вакууму за п. 5, яка **відрізняється** тим, що містить датчик тиску (18) за зазначеним парозбірником, який визначає фактичний стан тиску в контурі.
8. Сушильна установка високого вакууму за п. 7, яка **відрізняється** тим, що зазначений датчик тиску (18) являє собою перемикач повітряного тиску.
9. Сушильна установка високого вакууму за п. 8, яка **відрізняється** тим, що зазначений перемикач повітряного тиску (18) з'єднаний із зазначеним байпасним клапаном (17) та приводить до дії зазначений вторинний насос (9) при досягненні завданої величини P_s тиску, яка перевищує зазначену мінімальну робочу величину (P_i).